CoFeB センシング層を適用したセンサ用磁気トンネル接合における 磁気特性の MgO キャップ層膜厚依存性

Dependences of magnetic characteristics on thickness of MgO capping layer in magnetic tunnel junctions of CoFeB sensing layer for sensor applications

超低電圧デバイス技術研究組合(LEAP)', ○津嵜 陽亮', 長永 隆志',古川 泰助', 吉田 親子', 山崎 裕一', 青木 正樹', 射場 義久', 高橋 厚', 角田 浩司', 中林 正明', 能代 英之', 畑田 明良', 吉田 幸久', 佐竹 徹也', 杉井 寿博'

Low-power Electronics Association & Project (LEAP)¹, °Y. Tsuzaki¹, T. Takenaga¹, T. Furukawa¹, C. Yoshida¹, Y. Yamazaki¹, M. Aoki¹, Y. Iba¹, A. Takahashi¹, K. Tsunoda¹, M. Nakabayashi¹, H. Noshiro¹, A. Hatada¹, Y. Yoshida¹, T. Satake¹ and T. Sugii¹. E-mail: tsuzaki@leap.or.jp

【研究の背景】トンネル絶縁膜およびセンシング層にそれぞれ MgO 膜と CoFeB 膜を適用した磁気トンネル接合(magnetic tunnel junction; MTJ)は、磁気抵抗比(MR 比)が大きく $^{[1]}$ 、高感度・高精度な磁気センサとしての応用が期待されている。この際、MgO/CoFeB 界面での垂直磁気異方性(perpendicular magnetic anisotropy; PMA) $^{[2]}$ を活用し MgO 膜をキャップ層として適用することで、ヒステリシスの発生と CoFeB 膜厚に依存した特性の変化を抑制することが可能である $^{[3]}$ 。しかしながら、これまでにキャップ層の MgO 膜厚がセンサ用 MTJ の特性に与える影響について、十分な検討がなされていない。ここでは、MTJ 積層構造のベタ膜において、MgO キャップ層膜厚が与えるセンシング層 CoFeB 膜の磁気特性への影響を評価した。

【実験方法】MTJ の積層構造は、SiO₂-sub./Ta (3)/Ru (30)/Ta (10)/Ru (1)/PtMn (15)/CoFe (2.0)/Ru (0.8)/CoFeB (2.3)/MgO (1.75)/CoFeB (1.2)/MgO (t_{cap-MgO})/Ta (1)/Ru (30) (単位; nm) であり、スパッタリングにより成膜した。また、真空中で275℃、1.5T、2時間のアニールを行った。膜の磁気特性の評価には振動型磁力計を用い、膜面方向と膜面の垂直方向に磁界を印加して測定した。膜面方向の測定では、アニール時の磁界印加方向と同方向に磁界を印加した。

【結果】 図 1 には異なる $t_{\text{cap-MgO}}$ で得られる面内方向と面直方向の M-H 曲線を示し、図 2 には M-H 曲線から求めたセンシング層 CoFeB 膜の面直方向の飽和磁界 $H_{\text{s}_{\perp}}$ と面内方向の保磁力 H_{c} の $t_{\text{cap-MgO}}$ 依存性を、それぞれ示す。この結果、 H_{c} は $t_{\text{cap-MgO}}$ の $t_{\text{cap-MgO}}$ 依存性を、それぞれ示す。この結果、 $t_{\text{cap-MgO}}$ と $t_{\text{cap-MgO}}$ を $t_{\text{cap-MgO}}$ を $t_{\text{cap-MgO}}$ の $t_{\text{cap-MgO}}$ を $t_{\text{cap-MgO}}$ の $t_{\text{cap-MgO}}$ の $t_{\text{cap-MgO}}$ に $t_{\text{cap-MgO}}$ の $t_{\text{cap-MgO}}$ の $t_{\text{cap-MgO}}$ で $t_{\text{cap-MgO}}$ の $t_{\text{cap-MgO}$

以上の結果から、MgO キャップ層を適用したセンサ用 MTJにおいてヒステリシスを抑制するためには、センシング

(a) In-plane

(a) In-plane

(b) Perpendicular

(c) Perpendicular

(c)

図 1 各 MgO キャップ層膜厚における M-H 曲線と面直方向の飽和磁界 $H_{s\perp}$ の定義

図 2 面直方向の飽和磁界 $H_{s\perp}$, 面内方向の保磁力 H_c の MgO キャップ層膜厚依存性

層膜厚と同様にキャップ層 MgO 膜厚の調整も必要であることを確認した。 講演では上記のベタ膜の特性とセンサ用 MTJ の特性の相関についても言及する。

【謝辞】本研究は、経済産業省と NEDO の「低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト」に係わる業務委託として実施した。

【参考文献】[1]S. Yuasa *et al*, J. Phys. D: Appl. Phys.40, pp.337-354, 2007., [2]S. Ikeda *et al.*, Nature Mater.9, pp.721-724, 2009., [3]T. Takenaga *et al.*, J. Appl. Phys., 115, 17E524, 2014.